

広温度レンジに1台で対応

低温・高温・常温検査用 IC ハンドラ

広温度レンジ対応 低温・高温・常温検査ハンドラ

半導体の低温・高温・常温検査に対応するハンドラを開発しました。
対象温度は -50°C ~ $+150^{\circ}\text{C}$ の広温度範囲。
車載用半導体をはじめ、多様な半導体デバイスの試験・検査ニーズに対応します。

高効率温調を実現する専用冷却ユニット

温調システムには、高い評価をいただいている超低温二元冷凍機「AI-860」をベースに、ハンドラ専用として開発・最適化した熱源ユニットを採用。
広温度範囲での安定した温度制御と高効率運転を実現しました。
さらに水冷式のため、液体窒素方式と比較して、初期費用・運用コストの大幅な削減に貢献します。

操作性と段取り性

温度設定や調整は、ハンドラ本体と同一のタッチパネルから直感的に操作可能。
また、1台で低温から高温まで切り替えて使用できるため、
装置構成の集約と運用の効率化に寄与します。

生産性と拡張性

インデックスタイム 0.6 秒の高速動作により、マシンタイムの向上に貢献。
スタンドアロンでの運用に加え、インライン対応、全自動化など、用途・工程要件に応じたカスタマイズにも対応します。

名称	水冷式冷却装置一体型ハンドラ
概要	半導体の低温、高温、常温検査用に開発したハンドラ
外形寸法	2000x1700x1850 付帯設備除く
対象デバイス	QFP他
供給収納方法	JEDECトレイ 35段積
インデックスタイム	0.6秒
コンタクト荷重	1500N
テストサイト	4個測定(4個測以外も順次対応予定)
テスト温度範囲	-50°C ~ $+120^{\circ}\text{C}$ ($\pm 1^{\circ}\text{C}$)

